

# ドラフトチャンバー

## Draft chamber



半導体製造プロセスを強力にサポートする、洗浄専用ドラフトチャンバー。さまざまなカスタマイズに対応した、安全でクリーンな作業環境を提供します。

The draft chamber is used exclusively for cleaning, powerfully supporting the semiconductor production process.

A safe and clean work environment accommodating various customizations is provided.

### 特長

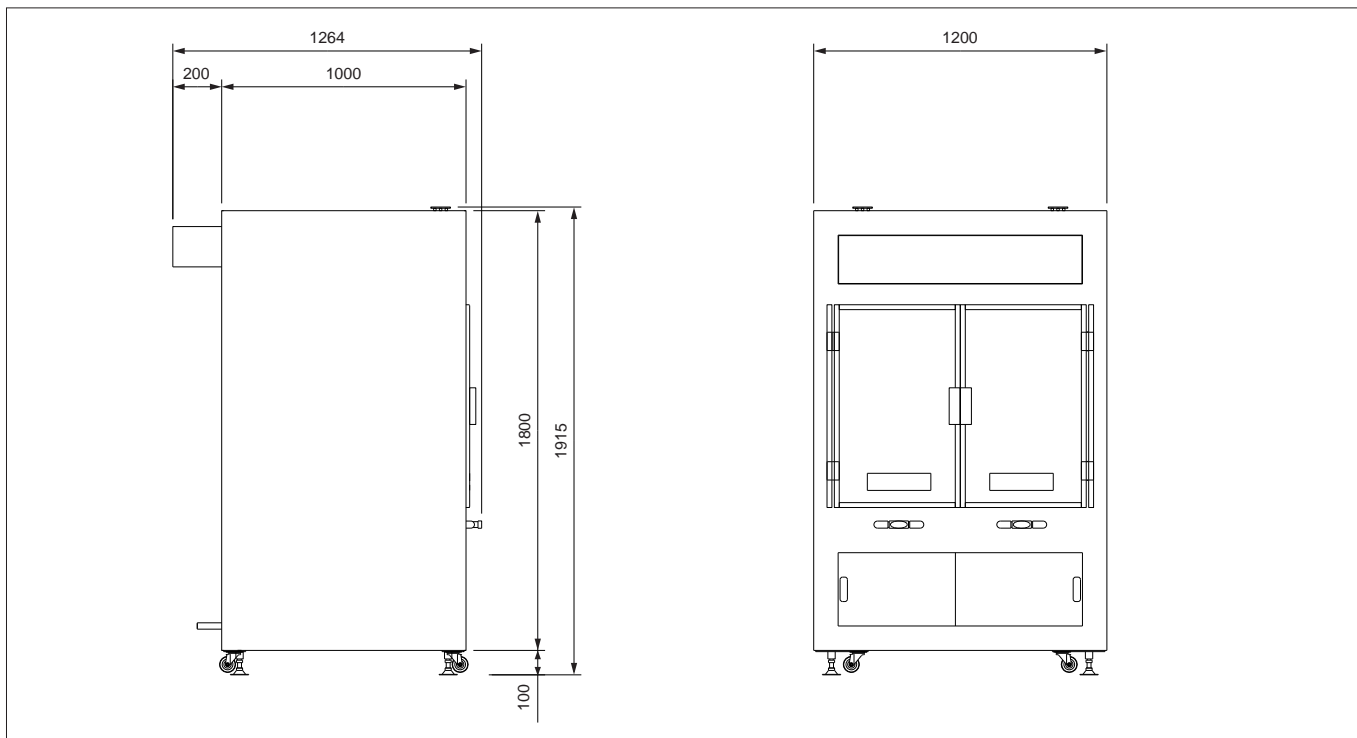
- 装置前面扉はスムーズな上下スライド式または、左右両開き式を選択できます。
- 扉の開口部は、ご希望に応じて、幅広く対応します。
- 薬液供給ユニットとの接続も可能です。

### Feature

- The front door can be selected from the smooth vertical sliding type or double swing door type.
- The door opening can be designed to customer requests.
- The draft chamber can be connected to the chemical supply unit.

# ドラフトチャンバー / Draft chamber

## ■概要図 / Space requirements



## ■装置本体仕様

装置寸法	1200mm (幅) × 1000mm (奥) × 1915mm (高)
装置材質	PVC
純水用蛇口	2カ所
純水ハンドシャワー	1カ所
N2ハンドガン	1カ所

## ■Equipment main body specifications

Equipment dimensions	1200 mm (W) x 1000 mm (D) x 1915 mm (H)
Equipment material	PVC
DI water spout	2
DI water hand shower	1
N2 hand gun	1

## ■用力取合い方向

純水・排気・電気	装置後部
N2	装置側面

## ■Utility supply location

DI water, exhaust, electricity	Equipment rear
N2	Equipment side

## ■用力表

	接続	材質	口数
純水	16A	PVC	1
N2	PT1/4	SUS	1
排気	150A	PVC	1
薬液ドレン	20A	PVC	1
廃水ドレン	40A	PVC	1
電気	1φ100V	—	1

## ■Utility list

	Connection	Material	Number
DI water	16A	PVC	1
N2	PT1/4	SUS	1
Exhaust	150A	PVC	1
Chemical drain	20A	PVC	1
Wastewater drain	40A	PVC	1
Electricity	1φ100V	—	1

## 株式会社 SEBACS / SEBACS CO., LTD.

本社：京都市右京区西京極新明町13-1 TEL. 075-323-2080 FAX. 075-323-2075  
 HEAD OFFICE: 13-1, Shinmei-cho, Nishikyogoku, Ukyoku, Kyoto 615-0864, JAPAN  
 TEL. +81-75-323-2080 FAX. +81-75-323-2075

東日本地区サービス拠点：東京SS 茨城SS 会津若松SS 北上SS 鶴岡SS  
 西日本地区サービス拠点：京都SS 三重SS 富山SS 広島SS 福山出張所  
 九州地区サービス拠点：熊本SS 長崎SS 大分SS